

618327-2560

ฟิสิกส์ของวัสดุอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์

นพ.อรรถัย วัชรกิจจากร

บทที่ 7

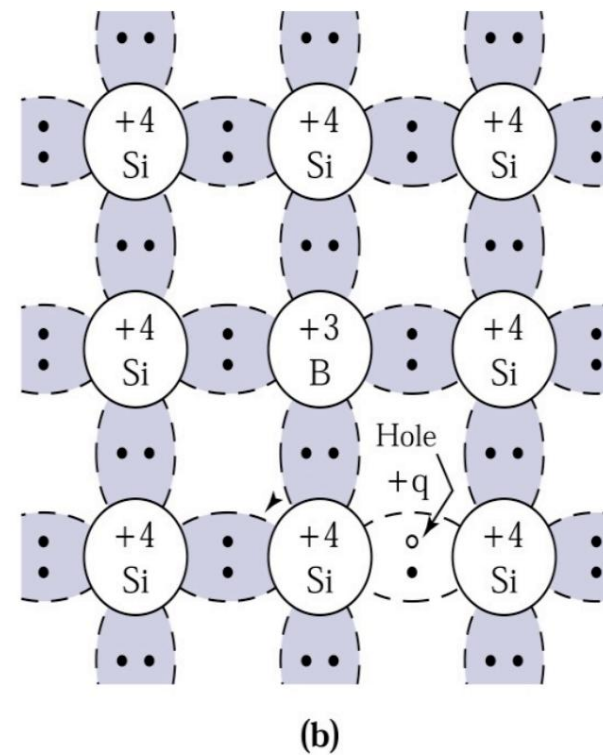
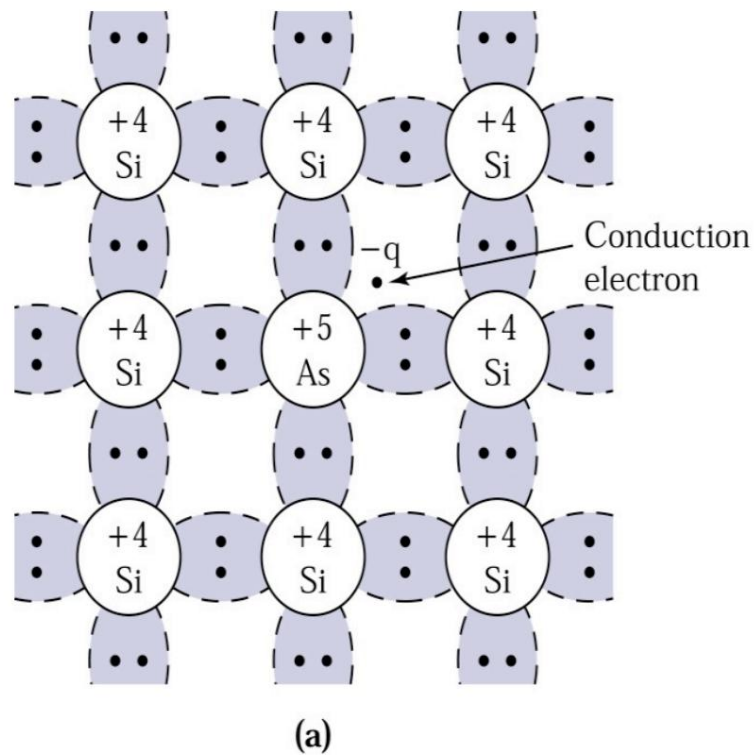
ผู้บริจาคและผู้รับ

- เมื่อสารกึ่งตัวนำถูกเจือปนด้วยสารเจือปนบางชนิด สารดังกล่าวจะกลายเป็นสาร **เจือปนจากภายนอก** เซมิคอนดักเตอร์ •

ระดับพลังงานของมันก็เปลี่ยนไปด้วย

ผู้บริจาคและผู้รับ

- รูปภาพแสดงภาพแผนผังของพันธะ n-type (a) และชนิด p (b)



ผู้บริจาคและผู้รับ

- สำหรับอะตอมประเภท n จากสิ่งเจือปนในกลุ่ม V จะปล่อยอิเล็กตรอนเพื่อการนำไฟฟ้าในฐานะตัวพาประจุอิสระ
- อิเล็กตรอนที่อยู่ในอะตอมของสิ่งเจือปนจะต้องการพลังงานน้อยกว่ามากในการนำไฟฟ้า (หรือถูกทำให้เป็นไอออน)
- อะตอมของสิ่งเจือปนเรียกว่า “ผู้ให้”
- พลังงานไอออไนเซชันของผู้บริจาคคือ $EC - ED$ โดยที่ ED คือพลังงานระดับผู้บริจาค

ผู้บริจาคและผู้รับ

- สำหรับ p-type อะตอมจากกลุ่ม III จะจับอิเล็กตรอนจากแถบวาเลนซ์ของสารกึ่งตัวนำ และสร้างโฮลซึ่งเป็นตัวพาประจุอิสระ
- EA เรียกว่า “ระดับตัวรับ” และ $EA - EV$ เรียกว่า “พลังงานระดับการแตกตัวของตัวรับ”
- พลังงานระดับการแตกตัวของตัวรับนี้มีขนาดเล็ก เนื่องจากสิ่งเจือปนของตัวรับสามารถรับอิเล็กตรอนได้อย่างง่ายดาย

ผู้บริจาคและผู้รับ

- พลังงานไอออไนเซชันหรือพลังงานยึดเหนี่ยวที่สร้างตัวพาประจุอิสระในสารกึ่งตัวนำสามารถแสดงได้โดยประมาณโดย

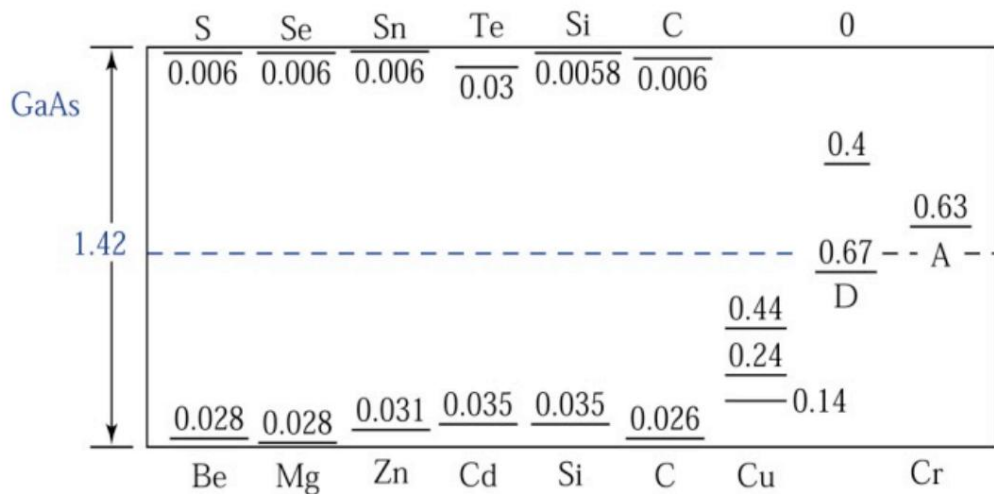
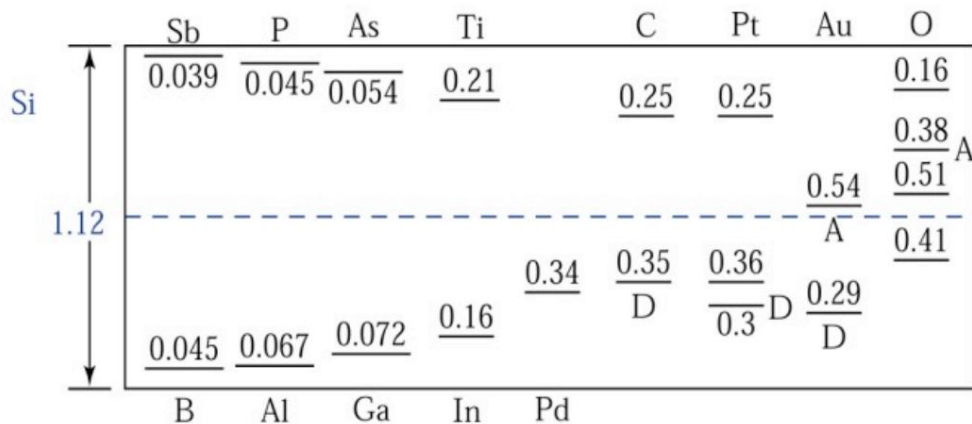
$$E_i = \frac{4 \cdot E_g}{8 - \epsilon_s \cdot \epsilon_{\infty}} \quad (1)$$

ที่ไหน

E_i - สำหรับอะตอมผู้บริจาค

E_{∞} - สำหรับอะตอมตัวรับ

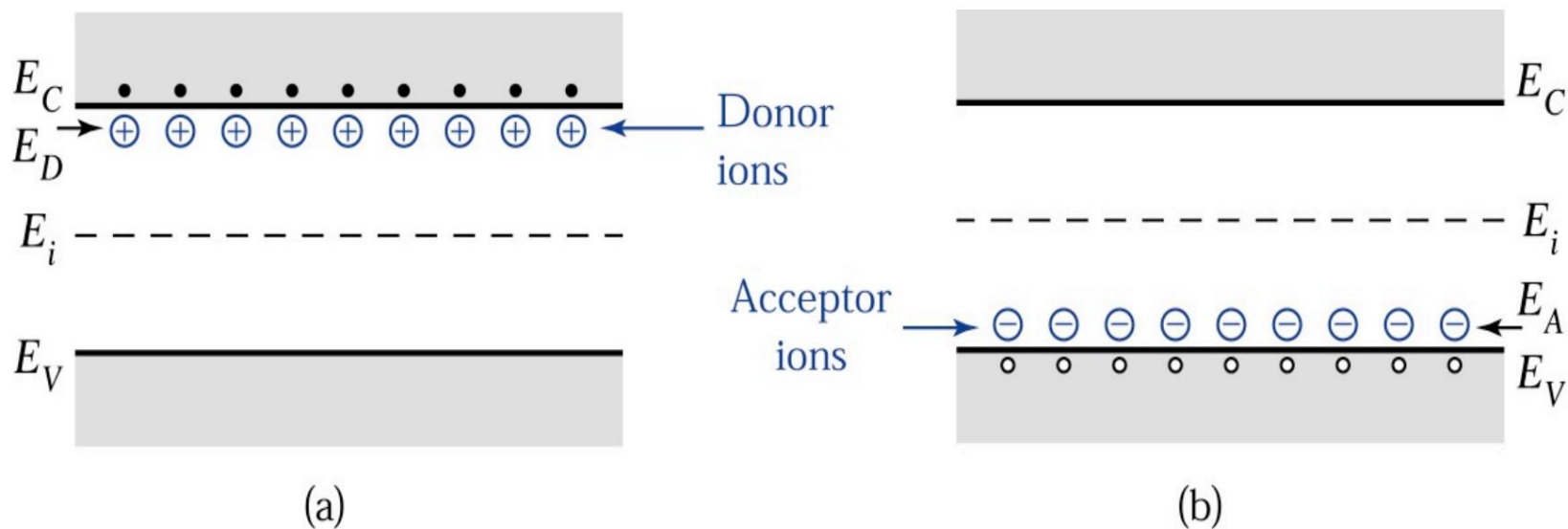
ผู้บริจาคและผู้รับ



ตัวอย่างที่ 1

- คำนวณพลังงานยึดเหนี่ยวโดยประมาณสำหรับผู้บริจาดใน
เกอ กำหนดให้ $er = 16$ และ $\bar{\epsilon} = 0.12\mu 0$.

ผู้บริจาคและผู้รับ



(ก) ไอออนของผู้บริจาค และ (ข) ไอออนของตัวรับ

ผู้บริจาคและผู้รับ

- พิจารณา สารกึ่งตัวนำ ชนิด n หาก ND คือจำนวนอิเล็กตรอนผู้บริจาคที่ระดับพลังงาน

ED แล้วเราให้นิยามว่าเป็นจำนวนตัวพาอิเล็กตรอนอิสระ (จำนวน ND ที่ไปเป็นการนำไฟฟ้า) หรือความหนาแน่นของอะตอมผู้ให้อิออนสามารถเขียนเป็น

เว็ชเอนอีเอฟอีโอ
ดีดี ดี

-

นั) นั

(2)

ผู้บริจาคและผู้รับ

- สำหรับ **p-type** อาร์กิวเมนต์จะคล้ายกัน ดังนั้น
ความหนาแน่นของรูอิสระหรืออะตอมตัวรับไอออน
ความหนาแน่นเขียนเป็น

น n_A n_i n_D n_A n_i n_D

(3)

ผู้บริจาคและผู้รับ

เราสามารถหาความสัมพันธ์ของระดับแฟร์มีกับอุณหภูมิได้สามกรณี:

- อุณหภูมิต่ำมาก
- อุณหภูมิปานกลาง
- อุณหภูมิสูงมาก.

ผู้บริจาคและผู้รับ

- อุณหภูมิต่ำมาก

$$E_F - E_D \gg kT$$

$$n = N_D^+$$

$$N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_D \left[1 - \frac{1}{e^{(E_D - E_F)/kT} + 1} \right]$$

$$N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_D \left[\frac{1}{e^{(E_F - E_D)/kT} + 1} \right]$$

ผู้บริจาคและผู้รับ

$$N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_D \left[\frac{1}{e^{(E_F - E_D)/kT}} \right]$$

Dividing by N_C and taking \ln

$$\frac{-(E_C - E_F)}{kT} = \ln \left(\frac{N_D}{N_C} \right) - \frac{(E_F - E_D)}{kT}$$

$$E_F = \left(\frac{E_C + E_D}{2} \right) + \frac{kT}{2} \ln \left(\frac{N_D}{N_C} \right)$$

ผู้บริจาคและผู้รับ

- อุณหภูมิปานกลาง

$$E_F - E_D < kT \ll E_g$$

In this case, all donors are ionized

$$n = N_D$$

$$N_C e^{-(E_C - E_F)/kT} = N_D$$

ผู้บริจาคและผู้รับ

[illegible]

อ้อ เคที ซี

$$\text{อ้อ}^{\text{เออ}} \text{ ทก}^{\text{ซี}} \quad \text{ใน}^{\text{เออ}} \frac{\text{เอิ้น}^{\text{ซี}}}{\text{เอิ้น}^{\text{ดี}} \div \text{เอิ้น}^{\text{เออ}}} \text{โอ้} \quad (4)$$

ผู้บริจาคและผู้รับ

- อุณหภูมิสูงมาก

- ในกรณีนี้ ผู้บริจาคทั้งหมดจะแตกตัวเป็นไอออน และอิเล็กตรอนจะถูกกระตุ้นจากแถบวาเลนซ์ไปยังแถบการนำไฟฟ้า
- นี่ทำหน้าที่เหมือนกับสารกึ่งตัวนำที่แท้จริงหรือ $EF = Ei$
- อาจเป็นประโยชน์ในการแสดงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนและหลุมในรูปของความเข้มข้นที่แท้จริง ของ n_i และระดับแฟร์มีที่ แท้จริง Ei

ผู้บริจาคและผู้รับ
สำหรับ **n-type** จาก

$$n = N_C \exp[-(E_C - E_F)/kT]$$

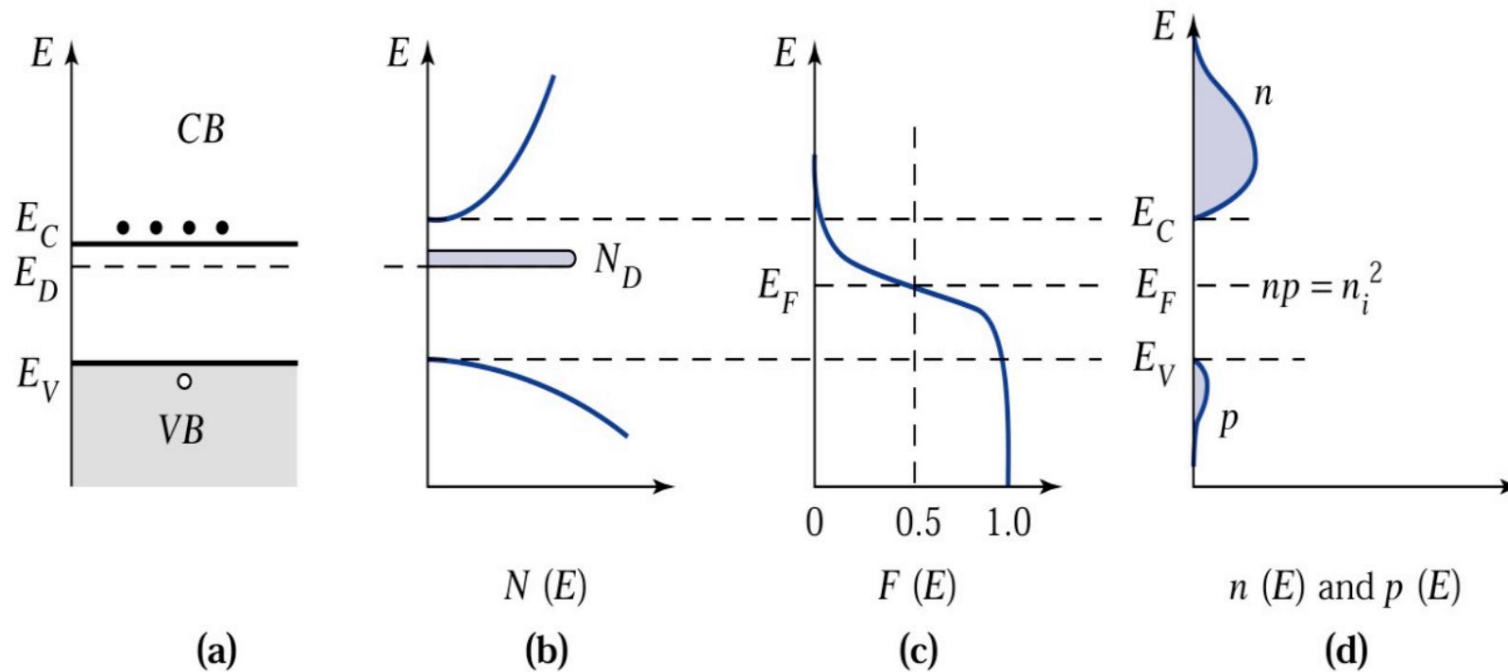
$$\begin{aligned} n &= N_C \exp[-(E_C - E_F)/kT] \\ &= N_C \exp[-(E_C - E_i)/kT] \exp[(E_F - E_i)/kT] \\ n &= n_i \exp[(E_F - E_i)/kT] \end{aligned} \quad (5)$$

ในทำนองเดียวกัน **ประเภทด้านบ** เรามี

$$p = n_i \exp[(E_i - E_F)/kT] \quad (6)$$

นี้ใช้ได้กับทั้ง **ภายใน** และภายนอก
สารกึ่งตัวนำภายใต้ภาวะสมดุลทางความร้อน

สารกึ่งตัวนำชนิด n



(ก) แผนภาพแบนด์ (ข) ความหนาแน่นของสถานะ (ค) ฟังก์ชันการแจกแจงของแฟร์มี (ง) ความเข้มข้นของตัวพา

สังเกตว่า $np = n_i^2$.

ผู้บริจาคและผู้รับ

- เราได้เรียนรู้วิธีการค้นหาตำแหน่งใหม่ของระดับแฟร์มีสำหรับสารกึ่งตัวนำนอกระยะ
- ตอนนี้เรามาพิจารณาความหนาแน่นของอิเล็กตรอนใหม่ในกรณีที่มีทั้งตัวให้ **ND** และตัวรับ **NA** พร้อมกัน • ระดับแฟร์มีจะปรับตัวเพื่อรักษาความเป็นกลางของประจุโดยรวม

กน พณอิน -

-

(7)

ผู้บริจาคและผู้รับ

- โดยการแก้สมการ (7) ด้วยสมการสมดุล $n \cdot p = n_i^2$ -
ความเข้มข้นของอิเล็กตรอนและโฮลใน **n-type**
ผลผลิตเซมิคอนดักเตอร์

$$n = \frac{1}{2} \left(N_D + \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2} \right) \quad (8)$$

$$\bar{p} = \frac{n_i^2}{n} \quad (9)$$

ผู้บริจาคและผู้รับ

- เช่นเดียวกับ สารกึ่งตัวนำ ชนิด p อิเล็กตรอน และความเข้มข้นของหลุมจะแสดงเป็น

$$p_{\vec{p}} = n_{\vec{p}} \sqrt{1 - \frac{u_{\vec{p}}^2}{c^2}} \quad (10)$$

$$u_{\vec{p}} = \frac{u_{\vec{p}}^2}{p_{\vec{p}}} \quad (11)$$

- โดยทั่วไป ในกรณีที่สิ่งเจือปนทั้งหมดแตกต่างกันเป็นไอออน สุทธิ

ความเข้มข้นของตัวพาที่แท้จริง n_i ; ดังนั้นเราอาจ

เพียงเขียนความสัมพันธ์ข้างต้นใหม่เป็น

မူဝါဒ - မူဝါဒ

ถ้า

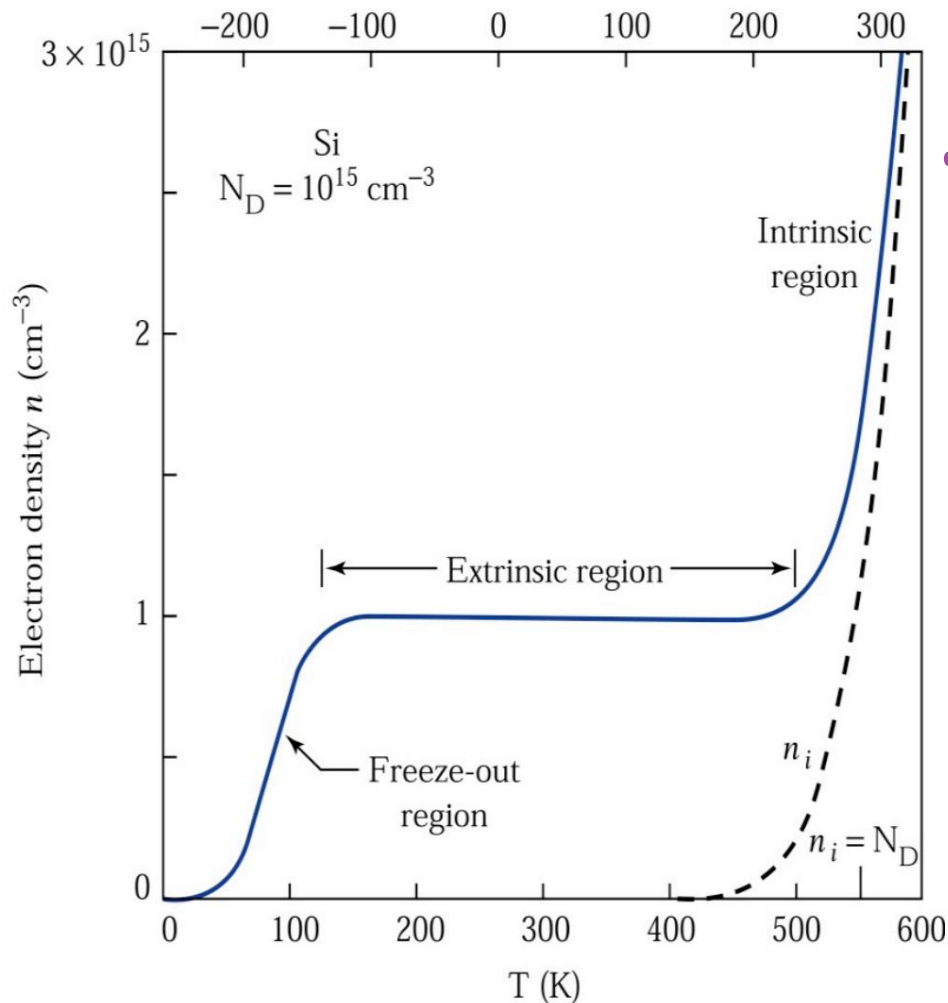
5

၉

พื้เอนเอนเอนเอน>

၁

ผู้บริจาคและผู้รับ



- รูปภาพแสดงอิเล็กตรอน
ความหนาแน่นใน Si เป็นฟังก์ชัน
ของอุณหภูมิสำหรับผู้บริจาค
ความเข้มข้นของ $N_D = 10^{15}$
ชม.-3.

ผู้บริจาคและผู้รับ

- ที่อุณหภูมิต่ำ สิ่งเจือปนของผู้บริจาคไม่สามารถแตกตัวเป็นไอออนได้ทั้งหมด ซึ่งเรียกว่า “**บริเวณการแข็งตัว**” เนื่องจากอิเล็กตรอนบางส่วนจะถูกแช่แข็งที่ระดับผู้บริจาค
- เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น สิ่งเจือปนทั้งหมดจะแตกตัวเป็นไอออน และจะยังคงเท่าเดิมในช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
- ภูมิภาคนี้เรียกว่า “**ภูมิภาคภายนอก**”

ผู้บริจาคและผู้รับ

- จนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีกและไปถึงจุดที่มีอิเล็กตรอนถูกกระตุ้นจากแถบวาเลนซ์
- สิ่งนี้ทำให้ความเข้มข้นของตัวพาที่แท้จริงนั้นเทียบได้กับความเข้มข้นของตัวให้
- ในภูมิภาคนี้ เซมิคอนดักเตอร์ทำหน้าที่เหมือนเป็น ส่วนประกอบที่แท้จริง

สารกึ่งตัวนำเสื่อม

- หากเซมิคอนดักเตอร์ถูกเจือปนอย่างหนักทั้งสำหรับ n-type หรือ p-type E_F จะสูงกว่า E_C หรือต่ำกว่า E_V ตามลำดับ
- สารกึ่งตัวนำเรียกว่า สารเสื่อมสภาพเซมิคอนดักเตอร์
- ส่งผลให้ bandgap ลดลงด้วย

สารกึ่งตัวนำเสื่อม

- การลดช่องว่างของแบนด์ ดีเช่น Si ที่ ห้อง อุณหภูมิจะแสดงโดย

$$\text{ดีอี}_{\text{จ}} = 22 \sqrt{\frac{\text{เอ็น}}{10^{18}}} \text{ วัตต์} \quad (12)$$

โดยที่การเจือปน N มีหน่วยเป็น cm^{-3}

ตัวอย่างที่ 2

- Si ถูกเจือด้วย อะตอมของ **อาร์เซนิค** 1,016 อะตอมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร หาคความเข้มข้นของตัวพาและระดับแฟร์มีที่อุณหภูมิห้อง (300K)

โซลน

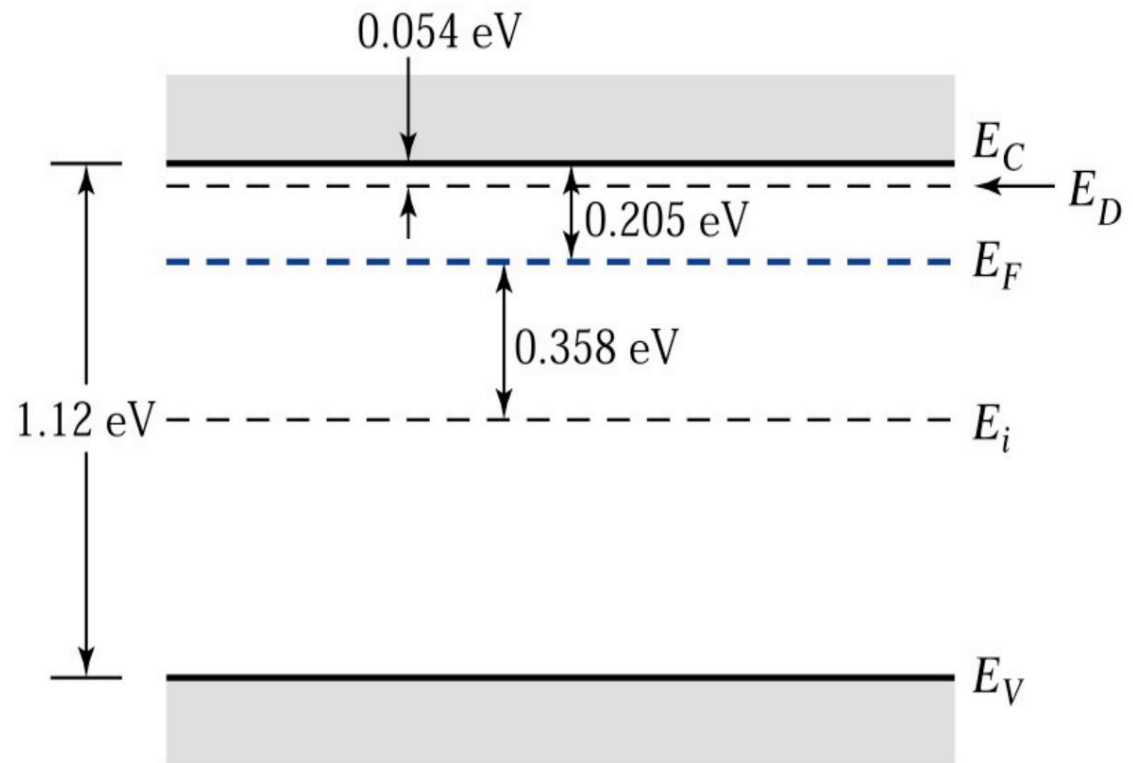
ที่อุณหภูมิห้อง ไอออนไนเซชันของสิ่งเจือปนสมบูรณ์

อะตอมมีความเป็นไปได้สูง ดังนั้นเรามี $n = ND = 1016 \text{ cm}^{-3}$

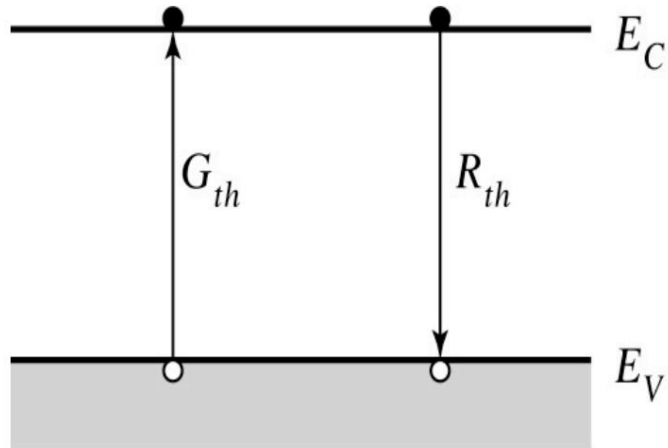
ตัวอย่างที่ 2

- โซลน
- ระดับแฟร์มีที่วัดจากระดับแฟร์มีที่แท้จริง

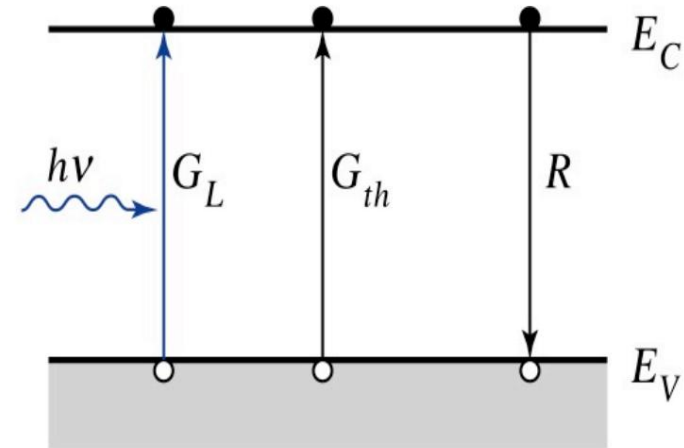
เป็น



การรวมตัวโดยตรง



(a)



(b)

- เมื่อพันธะระหว่างอะตอมข้างเคียงถูกทำลาย
คู่อิเล็กตรอน-หลุมถูกสร้างขึ้น
- อิเล็กตรอนวาเลนซ์เคลื่อนที่ขึ้นไป
แถบการนำไฟฟ้าเนื่องจากได้รับพลังงานความร้อน • ส่งผลให้มีช่องว่าง
เหลืออยู่ในแถบวาเลนซ์

การรวมตัวโดยตรง

- กระบวนการนี้เรียกว่า การสร้างพาหะ โดยมีอัตราการสร้าง G_{th} (จำนวนการสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮลต่อหน่วยปริมาตรต่อเวลา)
 - เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ลงจากแถบการนำไปยังแถบวาเลนซ์เพื่อรวมตัวใหม่กับโฮล กระบวนการย้อนกลับนี้เรียกว่า **การรวมตัวใหม่**
-
- อัตราการรวมตัวกันแสดงโดย R_{th}

การรวมตัวโดยตรง

- ภายใต้ภาวะสมดุลทางความร้อน อัตราการผลิต G_{th} เท่ากับอัตราการรวมตัวใหม่ R_{th} เพื่อรักษาสภาพของ

$$\text{พีเอ็นเอ็น} = \frac{2}{\text{อัน}} \quad (13)$$

- อัตราการรวมตัวกันโดยตรง R สามารถเป็นได้
แสดงออกมาเป็น

$$s n \text{ พี} = \quad (14)$$

ที่ไหน บี คือค่าคงที่ของความเป็นสัดส่วน

การรวมตัวโดยตรง

- ดังนั้นสำหรับสารกึ่งตัวนำชนิด n เรามี

$$G_{\text{In}} = \frac{q n_0 \mu_n E}{L_n} \quad (15)$$

โดยที่ n_0 และ p_0 แสดงถึงความหนาแน่นของอิเล็กตรอนและหลุม
ที่ภาวะสมดุลทางความร้อน

การรวมตัวโดยตรง

- หากใช้แสงกับเซมิคอนดักเตอร์ แสงจะสร้างคู่อิเล็กตรอน-โฮลด้วยอัตรา GL
 ความเข้มข้นของตัวพาจะสูงกว่าค่าสมดุล • อัตราการสร้างและการรวมตัวกันใหม่
 จะกลายเป็น

$$G = G_0 + L_{th}$$

(16)

$$n = n_0 + \Delta n, \quad p = p_0 + \Delta p$$

(17)

โดยที่ Δn และ Δp คือความเข้มข้นของตัวพาส่วนเกิน

การรวมตัวโดยตรง

$$d_i = \frac{d_i}{d_i} \quad (18ก)$$

$$d_i = \frac{d_i}{d_i} \quad (18 ข)$$

- $D_n = D_p$ เพื่อรักษาความเป็นกลางของประจุโดยรวม • อัตราสุทธิของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของรูจะแสดงเป็น

$$\frac{d_i}{d_i} = \frac{d_i}{d_i} \quad (19)$$

การรวมตัวโดยตรง

- ในสภาวะคงที่ $dpn/dt = 0$ จาก (19) เราได้

$$J = \frac{1}{2} \left(\frac{dpn}{dt} \right)^2 \quad (20)$$

โดยที่ U คืออัตราการรวมตัวสุทธิ

การแทนที่ (15) และ (17) ใน (20) จะได้ผลลัพธ์ดังนี้

$$J = \frac{1}{2} \left(\frac{dpn}{dt} \right)^2 \quad (21)$$

การรวมตัวโดยตรง

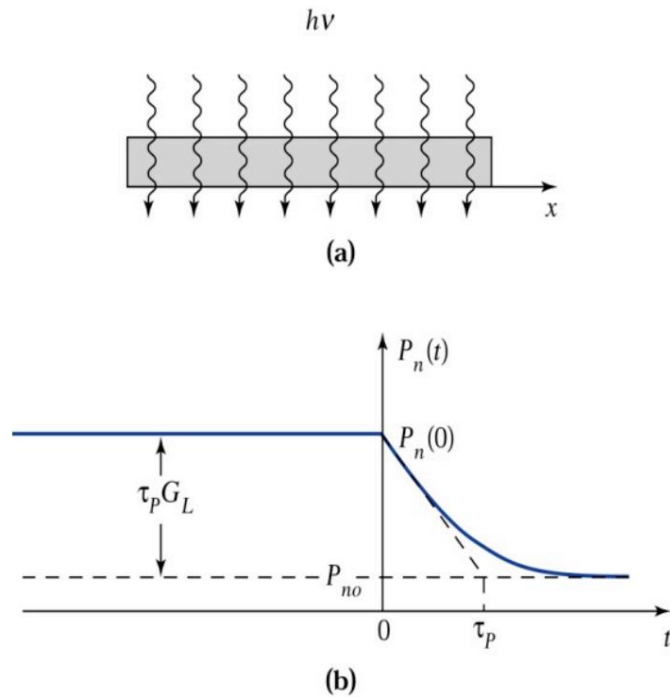
- สำหรับการฉีดระดับต่ำ $D_p, p_{n0} \ll n_{n0}$, (21) จะกลายเป็น

$$J_n = \frac{q D_p n_{n0}^2}{L_p} \left(\frac{1}{p_{n0}} - \frac{1}{n_{n0}} \right) \quad (22)$$

- ที่ไหน L_p เรียกว่า ผู้ให้บริการรายย่อยส่วนเกินตลอดชีพ

$$L_p = \sqrt{D_p \tau_p} \quad (23)$$

การรวมตัวโดยตรง



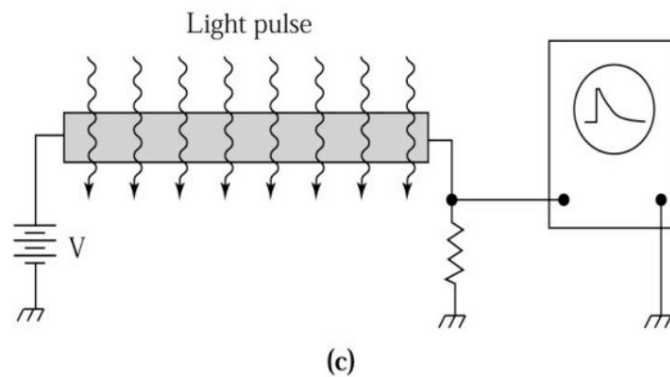
- เราอาจเขียน pn ใน
หน้าที่ของ t เป็น

$$p(t)G = +0 \quad \text{ที่}$$

u ีเอ็นพีแอล

$$\text{เอ็กซ์เพอเนนเชียล} \quad \text{ที่}$$

พี -



(24)

ตัวอย่างที่ 3

- ตัวอย่าง Si ที่มี $n_0 = 10^{14} \text{ cm}^{-3}$ ได้รับการส่องสว่างด้วยแสงและ คู่อิเล็กตรอน-โฮล $10^{13} \text{ คู่ / cm}^3$ สร้างทุกไมโครวินาที ถ้า $\tau = 2 \text{ } \mu\text{s}$ หา $n_u - n_p$ การเปลี่ยนแปลงในความเข้มข้นของพาหะกลุ่มน้อย